



# 检 测 报 告

## TEST REPORT

报告编号: KDHJ245106

检测类别:	委托检测
项目名称:	废气检测
委托单位:	无锡华润上华科技有限公司

江苏康达检测技术股份有限公司  
KANG DA TESTING TECHNOLOGY (JIANG SU) Co., Ltd.



# 声 明

一、本报告加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后生效；本报告无编制、审核、签发者签名无效。

二、本检测报告只对所检样品的检测结果负责；对委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品负责。

三、用户对本报告若有异议，可在收到本报告后 15 日内，向本公司书面提出异议，逾期不提出，则视为认可本报告。

四、未经本公司书面批准，不得以任何形式复制（全文复制除外）本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

五、除客户特别申明并支付样品保管费外，超过合同约定保存时间或标准规定时效的样品均不再保留。

六、本公司对本报告的检测数据保守秘密；除客户特别申明并支付档案管理费或法律规定的特殊要求外，本次已存档的检测报告保存期限为 6 年。

地 址：中国 江苏省 苏州市 苏州工业园区 长阳街 259 号钟园工业坊 3、4 栋

邮政编码：215000

电 话：0512-65733680

电子邮件：zyf@ehscare.org

检测报告

委托单位	无锡华润上华科技有限公司		
通讯地址	江苏省无锡市新吴区锡士路		
联系人	高扬	联系电话	13961774334
采样日期	2024-05-20~2024-05-21	分析日期	2024-05-20~2024-05-22
检测目的	为客户了解污染物排放情况提供检测数据。		
检测结论	检测结果见表1。		
<div>编制：丁玉清</div> <div>审核：封岳</div> <div>签发：孙爱平</div> <div>检测机构检验章</div> <div>签发日期：2024 年 06 月 03 日</div> <div></div>			

表 1-1 固定污染源废气检测结果表（5 月 20 日）

点位名称		FQ-012 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		20.4	20.3	19.9	20.2	/
标态烟气量（Nm³/h）		23967	24636	25657	24753	/
硫酸雾	排放浓度(mg/m³)	0.96	0.45	0.36	0.59	5.0
	排放速率（kg/h）	0.015				/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	0.67	1.39	0.95	1.00	10
	排放速率（kg/h）	0.025				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-2 固定污染源废气检测结果表（5 月 20 日）

点位名称		FQ-012 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		19.9	19.9	19.9	19.9	/
标态烟气量（Nm³/h）		23089	23024	23485	23199	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
氮氧化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计），氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-3 固定污染源废气检测结果表（5 月 20 日）

点位名称		FQ-012 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		20.4	19.9	19.9	20.1	/
标态烟气量（Nm³/h）		23967	25657	23485	24370	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-4 固定污染源废气检测结果表（5 月 20 日）

点位名称		FQ-013 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		19.9	19.9	19.9	19.9	/
标态烟气量（Nm³/h）		25210	25825	25619	25551	/
硫酸雾	排放浓度(mg/m³)	0.41	0.40	0.72	0.51	5.0
	排放速率（kg/h）	0.013				/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	3.29	4.58	0.68	2.85	10
	排放速率（kg/h）	0.073				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。					

表 1-5 固定污染源废气检测结果表（5 月 20 日）

点位名称		FQ-013 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		20.0	20.4	20.1	20.2	/
标态烟气量（Nm³/h）		26074	24817	25275	25389	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
氮氧化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计），氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					



表 1-6 固定污染源废气检测结果表（5 月 20 日）

点位名称		FQ-013 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		19.9	19.9	20.1	20.0	/
标态烟气量（Nm³/h）		25210	25619	25275	25368	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	1.3	0.6	ND	0.7	5.0
	排放速率（kg/h）	0.018				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-7 固定污染源废气检测结果表（5 月 20 日）

点位名称		FQ-014 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		20.4	21.0	20.9	20.8	/
标态烟气量（Nm³/h）		35773	37662	37174	36870	/
硫酸雾	排放浓度(mg/m³)	0.31	0.34	0.39	0.35	5.0
	排放速率（kg/h）	0.013				/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	1.17	1.40	1.79	1.45	10
	排放速率（kg/h）	0.053				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。					

表 1-8 固定污染源废气检测结果表（5 月 20 日）

点位名称		FQ-014 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		20.5	20.4	20.4	20.4	/
标态烟气量（Nm³/h）		39092	39623	39726	39480	/
氮氧化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-9 固定污染源废气检测结果表（5 月 20 日）

点位名称		FQ-014 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		21.0	20.5	20.4	20.6	/
标态烟气量（Nm³/h）		38842	39092	39623	39186	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计）。					

表 1-10 固定污染源废气检测结果表（5 月 20 日）

点位名称		FQ-014 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		20.4	21.0	20.4	20.6	/
标态烟气量（Nm³/h）		35773	38842	39623	38079	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-11 固定污染源废气检测结果表（5 月 20 日）

点位名称		FQ-015 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		20.5	20.9	20.8	20.7	/
标态烟气量（Nm³/h）		34476	35227	37951	35885	/
硫酸雾	排放浓度(mg/m³)	0.52	0.49	0.61	0.54	5.0
	排放速率（kg/h）	0.019				/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	4.95	0.99	1.33	2.42	10
	排放速率（kg/h）	0.087				/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计）。					

表 1-12 固定污染源废气检测结果表（5 月 20 日）

点位名称		FQ-015 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		21.3	20.4	20.4	20.7	/
标态烟气量（Nm³/h）		34293	35477	36089	35286	/
氮氧化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-13 固定污染源废气检测结果表（5 月 20 日）

点位名称		FQ-015 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		20.5	20.9	21.3	20.9	/
标态烟气量（Nm³/h）		34476	35134	34293	34634	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	0.9	ND	ND	0.4	5.0
	排放速率（kg/h）	0.014				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-14 固定污染源废气检测结果表（5 月 20 日）

点位名称		FQ-005 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		酸喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		23.2	23.2	25.0	23.8	/
标态烟气量（Nm³/h）		11528	11218	11213	11320	/
氨	排放浓度（mg/m³）	ND	ND	ND	ND	10
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 2、“ND”表示未检出，氨的检出限为 0.25mg/m³（采样体积以 10L 计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。					

表 1-15 固定污染源废气检测结果表（5 月 20 日）

点位名称		FQ-006 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		酸喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		24.6	24.3	25.1	24.7	/
标态烟气量（Nm³/h）		17073	16354	16318	16582	/
氨	排放浓度（mg/m³）	ND	ND	ND	ND	10
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 2、“ND”表示未检出，氨的检出限为 0.25mg/m³（采样体积以 10L 计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。					

表 1-16 固定污染源废气检测结果表（5 月 20 日）

点位名称		FQ-011 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		酸喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		23.4	24.1	23.8	23.8	/
标态烟气量（Nm³/h）		13616	13349	13935	13633	/
氨	排放浓度（mg/m³）	ND	ND	ND	ND	10
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 2、“ND”表示未检出，氨的检出限为 0.25mg/m³（采样体积以 10L 计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。					

表 1-17 固定污染源废气检测结果表（5 月 20 日）

点位名称		FQ-016 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		酸喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		24.7	20.1	20.0	21.6	/
标态烟气量（Nm³/h）		18764	18843	18855	18821	/
氨	排放浓度（mg/m³）	ND	ND	ND	ND	10
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 2、“ND”表示未检出，氨的检出限为 0.25mg/m³（采样体积以 10L 计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。					



表 1-18 固定污染源废气检测结果表（5 月 20 日）

点位名称		FQ-017 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		酸喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		26.3	23.7	22.4	24.1	/
标态烟气量（Nm³/h）		19680	20339	20161	20060	/
氨	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	10
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 2、“ND”表示未检出，氨的检出限为 0.25mg/m³（采样体积以 10L 计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。					

表 1-19 固定污染源废气检测结果表（5 月 21 日）

点位名称		FQ-001 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		20.2	20.0	20.1	20.1	/
标态烟气量（Nm³/h）		42622	42752	42240	42538	/
硫酸雾	排放浓度(mg/m³)	0.22	0.26	0.36	0.28	5.0
	排放速率（kg/h）	0.012				/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	1.23	1.91	2.65	1.93	10
	排放速率（kg/h）	0.082				/
氮氧化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-20 固定污染源废气检测结果表（5 月 21 日）

点位名称		FQ-001 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		19.9	19.4	19.3	19.5	/
标态烟气量（Nm³/h）		39402	42526	41438	41122	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计）。					

表 1-21 固定污染源废气检测结果表（5 月 21 日）

点位名称		FQ-001 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		20.2	20.1	19.3	19.9	/
标态烟气量（Nm³/h）		42622	42240	41438	42100	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	0.6	ND	ND	0.3	5.0
	排放速率（kg/h）	0.013				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-22 固定污染源废气检测结果表（5 月 21 日）

点位名称		FQ-002 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		24.0	23.9	23.8	23.9	/
标态烟气量（Nm³/h）		62781	64772	65118	64224	/
硫酸雾	排放浓度(mg/m³)	0.38	0.38	0.41	0.39	5.0
	排放速率（kg/h）	0.025				/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	3.21	3.19	0.94	2.45	10
	排放速率（kg/h）	0.16				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。					

表 1-23 固定污染源废气检测结果表（5 月 21 日）

点位名称		FQ-002 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		23.2	23.1	23.3	23.2	/
标态烟气量（Nm³/h）		66161	61952	65232	64448	/
氮氧化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-24 固定污染源废气检测结果表（5 月 21 日）

点位名称		FQ-002 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		23.2	23.4	23.2	23.3	/
标态烟气量（Nm³/h）		64141	66787	66161	65696	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计）。					

表 1-25 固定污染源废气检测结果表（5 月 21 日）

点位名称		FQ-002 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		24.0	23.8	23.2	23.7	/
标态烟气量（Nm³/h）		62781	65118	66161	64687	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	0.6	0.5	0.4	5.0
	排放速率（kg/h）	0.026				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-26 固定污染源废气检测结果表（5 月 21 日）

点位名称		FQ-003 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		20.0	19.6	19.8	19.8	/
标态烟气量（Nm³/h）		43683	43987	45327	44332	/
硫酸雾	排放浓度(mg/m³)	0.41	0.31	ND	0.27	5.0
	排放速率（kg/h）	0.012				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，硫酸雾的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 400L 计）。					

表 1-27 固定污染源废气检测结果表（5 月 21 日）

点位名称		FQ-003 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		20.1	19.9	19.5	19.8	/
标态烟气量（Nm³/h）		41424	44691	40752	42289	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
氮氧化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计），氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-28 固定污染源废气检测结果表（5 月 21 日）

点位名称		FQ-003 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		19.6	19.8	20.1	19.8	/
标态烟气量（Nm³/h）		43987	45327	41424	43579	/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	2.37	1.72	0.56	1.55	10
	排放速率（kg/h）	0.068				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。					

表 1-29 固定污染源废气检测结果表（5 月 21 日）

点位名称		FQ-003 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		20.0	20.1	19.5	19.9	/
标态烟气量（Nm³/h）		43683	41424	40752	41953	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					



表 1-30 固定污染源废气检测结果表（5 月 21 日）

点位名称		FQ-004 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		21.0	20.9	20.9	20.9	/
标态烟气量（Nm³/h）		22934	25742	26901	25192	/
硫酸雾	排放浓度(mg/m³)	0.25	0.26	0.29	0.27	5.0
	排放速率（kg/h）	6.8×10 <sup>-3</sup>				/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	0.46	3.68	2.09	2.08	10
	排放速率（kg/h）	0.052				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。					

表 1-31 固定污染源废气检测结果表（5 月 21 日）

点位名称		FQ-004 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		20.8	20.5	20.4	20.6	/
标态烟气量（Nm³/h）		28105	27337	27442	27628	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
氮氧化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计），氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-32 固定污染源废气检测结果表（5 月 21 日）

点位名称		FQ-004 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		21.0	20.8	20.4	20.7	/
标态烟气量（Nm³/h）		22934	28105	27442	26160	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-33 固定污染源废气检测结果表（5 月 21 日）

点位名称		FQ-010 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		22.2	22.0	22.0	22.1	/
标态烟气量（Nm³/h）		38323	38844	37800	38322	/
硫酸雾	排放浓度(mg/m³)	0.55	0.94	0.51	0.67	5.0
	排放速率（kg/h）	0.026				/
氮氧化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-34 固定污染源废气检测结果表（5 月 21 日）

点位名称		FQ-010 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		22.2	22.0	22.0	22.1	/
标态烟气量（Nm³/h）		38323	38844	38844	38670	/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	0.83	1.09	0.89	0.94	10
	排放速率（kg/h）	0.036				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。					

表 1-35 固定污染源废气检测结果表（5 月 21 日）

点位名称		FQ-010 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		22.5	22.4	22.5	22.5	/
标态烟气量（Nm³/h）		39064	39222	38665	38984	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计） 3、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。					

表 1-36 固定污染源废气检测结果表（5 月 20 日）

点位名称		FQ-010 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		22.2	22.5	22.5	22.4	/
标态烟气量（Nm³/h）		38323	39064	38665	38684	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-37 固定污染源废气检测结果表（5 月 21 日）

点位名称		FQ-049 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		33.8	33.5	33.4	33.6	/
标态烟气量（Nm³/h）		1921	2012	2011	1981	/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	1.64	2.91	2.13	2.23	10
	排放速率（kg/h）	4.4×10 <sup>-3</sup>				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。					

表 1-38 固定污染源废气检测结果表（5 月 21 日）

点位名称		FQ-050 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		酸喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		32.4	33.1	34.2	33.2	/
标态烟气量（Nm³/h）		1051	961	1129	1047	/
氨	排放浓度(mg/m³)	1.13	0.31	0.35	0.60	10
	排放速率（kg/h）	6.3×10 <sup>-4</sup>				/
备注	1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 2、排气筒高度由受检单位提供。					

表 1-39 固定污染源废气检测结果表（5 月 21 日）

点位名称		FQ-051 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		活性炭吸附				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		33.0	34.4	34.9	34.1	/
标态烟气量（Nm³/h）		1781	1589	1586	1652	/
氨	排放浓度（mg/m³）	0.47	ND	1.58	0.73	10
	排放速率（kg/h）	1.2×10 <sup>-3</sup>				/
备注	1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 2、“ND”表示未检出，氨的检出限为 0.25mg/m³（采样体积以 10L 计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。					

表 1-40 固定污染源废气检测结果表（5 月 21 日）

点位名称		FQ-051 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		活性炭吸附				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	最大值	排放限值
烟气温度（℃）		33.0	35.9	35.4	/	/
标态烟气量（Nm³/h）		1781	1637	1521	/	/
硫化氢	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	/	/
	排放量（kg/h）	/	/	/	/	1.8
臭气浓度	无量纲	35	30	41	41	15000
备注	1、排放限值：《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表 2 限值。 2、“ND”表示未检出，硫化氢的检出限为 1.0mg/m³。 3、排气筒高度由受检单位提供。					



表 1-41 固定污染源废气检测结果表（5 月 21 日）

点位名称		FQ-021 废气排气筒		排气筒高度（m）		25
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		30.7	29.9	29.8	30.1	/
标态烟气量（Nm³/h）		5817	5679	5674	5723	/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	1.43	2.23	2.31	1.99	10
	排放速率（kg/h）	0.011				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。					

表 2 检测依据表

检测项目	检测依据
有组织废气	
氟化物	《大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法》（HJ/T 67-2001）
氯化氢	《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》（HJ 549-2016）
硫酸雾	《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》（HJ 544-2016）
氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》（HJ 693-2014）
氯气	《固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法》（HJ/T 30-1999）
氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 533-2009）
臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》（HJ 1262-2022）
硫化氢	《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法》（GB/T 14678-1993）
备注	/

表 3 仪器一览表

仪器编号	仪器名称	仪器型号
X-016-26、X-016-22、X-016-12、 X-016-09、X-016-08	智能双路烟气采样器	崂应 3072
X-046-05	数位温度表	TES-1310
F-001-14、F-001-13	紫外-可见分光光度计	TU-1810PC
X-015-105	阻容法烟气含湿量多功能检测器	1062D 型
X-015-109、X-015-37、X-015-19、 X-015-60	自动烟尘（气）测试仪	崂应 3012H
X-015-93	自动烟尘(气)测试仪	崂应 3012H-C
F-010-08	离子色谱仪	883
F-014-13	离子计	PXSJ-216F
F-010-15、F-010-20	离子色谱仪	ECO IC
X-015-77	烟气综合分析仪	崂应 3022
X-060-44	充电便携采气桶	labtm009
F-002-24	气相色谱仪	GC-2030

\*\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*\*